



イオンビームスパッタ/エッチング (IBS/IBE) 装置

- MBEに匹敵する成膜
- 常温で高パッキング密度
- アシストで酸化膜、窒化膜の多層膜可能
- コンパクト設計、イージーオペレーション及び拡張性
- Arガス使用のため、排気ガスの処理不要
- IBS/IBE複合装置やガス空冷式ステージ及び各種EPD(光学式又はSIMS)搭載可能

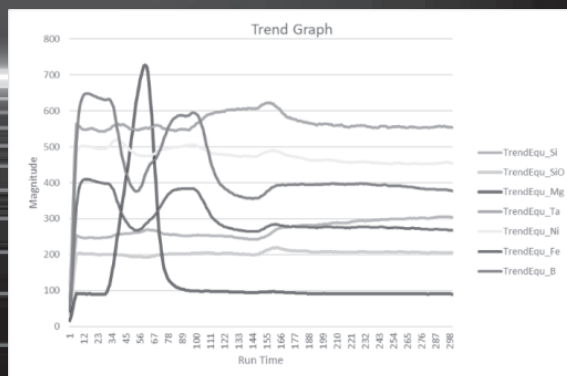


イオンビームスパッタ/エッチング アプリケーションを提案します



光学式エンドポイントディテクタ (EPD) - イオンビームエッチング -

- 深紫外 (DUV) 高感度特性
- 優れたS/N比
- IBE専用設計
- 製造ラインで信頼を得た終点アルゴリズム



アールエムテック株式会社
Revolution Mother Technologies

東京都中央区日本橋浜町 2-5-1 東洋浜町ビル5階
TEL 03-3667-0301 e-mail: customer@rmtec.co.jp
[https:// www.rmtec.co.jp](https://www.rmtec.co.jp)